



ZAPROSZENIE

na Seminarium Naukowo - Techniczne pt.:

„Nowoczesne metody badania materiałów stosowane w inżynierii powierzchni w mikro- i nano- skali”

które odbędzie się w dniach

26-27 czerwca 2018 r.

w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice

organizatorzy

dr hab. inż. Jerzy Łabaj prof. nzw. w Pol. Śl.

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Dariusz Kuc prof. nzw. w Pol. Śl.

Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej

dr inż. Aleksander Iwaniak - przewodniczący
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej

Optotom Warszawa



„Nowoczesne metody badania materiałów stosowane w inżynierii powierzchni w mikro- i nano- skali”

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
sala nr 105 (I piętro)

Program Seminarium:

26.06.2018 (wtorek)

- 9:00 – 9:30 „Nowoczesne Rozwiązania Obrazowania Wykorzystywane w Dziedzinie Badań Materiałowych – skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia bliskich oddziaływań, mikroskopia korelatywna SEM-SPM” – Łukasz Zarodkiewicz, MSA System
- 9:30 – 10:00 „Benefits of combining different 3D metrology techniques – optical profilometry” – Albert Sánchez, Sensofar
- 10:30 – 15:00 **Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem systemów (podział na grupy)**

27.06.2018 (środa)

- 9:00 – 9:30 „Nowoczesne Urządzenia Wykorzystywane w Dziedzinie Badań Materiałowych – mikro-tomografia komputerowa CT” – Łukasz Zarodkiewicz, MSA System
- 9:30 – 10:00 „Cyfrowa Analiza Obrazu w Mikroskopii Optycznej – kamery i oprogramowanie ” – Mariusz Władowski, Optotom
- 10:30 – 15:00 **Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem systemów (podział na grupy)**

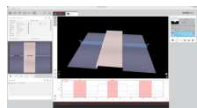
Udział w Seminarium jest bezpłatny, jednakże ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrację do dnia 22.06.2018r.

Podczas Seminarium istnieje możliwość zbadania własnych próbek!

Uczestnicy Seminarium otrzymają imienny certyfikat ze szkolenia!

Do dyspozycji Państwa będą następujące systemy:

- Profilometr Optyczny **Sensofar Sneox**
- Skaningowy Mikroskop Elektronowy **JEOL Neoscope** z przystawką EDS
- Mikrotomograf rentgenowski, Mikroskop AFM
- Najnowsze mikroskopy optyczne **Nikon** z cyfrową analizą obrazu



kontakt: Mariusz Władowski: mariusz.wladowski@optotom.pl, tel. 664 212 077

dr inż. Aleksander Iwaniak: aleksander.iwaniak@polsl.pl, tel. 32 603 44 80